

Title (en)

Process for drying an active part, and apparatus for carrying out this process

Title (de)

Verfahren zum Trocknen eines Aktivteils und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens

Title (fr)

Procédé de séchage d'une pièce active, et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé

Publication

EP 1253389 A1 20021030 (DE)

Application

EP 02405256 A 20020402

Priority

- EP 02405256 A 20020402
- EP 01810399 A 20010424

Abstract (en)

The method involves heating the active part to a final temperature value (Tend) by spraying with warm oil in a housing and passing current through the coil(s) and extracting water from the active part by a pressure reduced relative to atmospheric. Before spraying heated oil, the pressure (p) in the housing is reduced to a value greater than a desired value (ppasch) and lower than an upper limit ensuring a high water evaporation rate. An Independent claim is also included for the following: an arrangement for implementing the method.

Abstract (de)

Das Verfahren dient der Trocknung eines mindestens eine Wicklung und Feststoffisolationen enthaltenden Aktivteils. Das Aktivteil ist in einem vakuumdichten Gehäuse angeordnet und wird dort durch erwärmtes Öl und durch einen in der Wicklung geführten Strom (I) auf einen Temperaturendwert (Tend) aufgeheizt. Das erwärmte Öl wird bei reduziertem Druck (p) und eingeschaltetem Strom (I) im Gehäuse versprührt. Hierbei wird dem Aktivteil Wasser entzogen. Das versprühte Öl wird nach Abgabe von Wärme an das Aktivteil am Gehäuseboden gesammelt und nach Wiedererwärmen bei reduziertem Druck und eingeschaltetem Strom erneut im Gehäuse versprührt. Das Aktivteil wird so besonders rasch und schonend getrocknet. <IMAGE>

IPC 1-7

F26B 7/00; H01F 27/14

IPC 8 full level

F26B 3/353 (2006.01); **F26B 5/00** (2006.01); **F26B 5/04** (2006.01); **H01F 27/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

F26B 3/353 (2013.01); **F26B 5/005** (2013.01); **F26B 5/04** (2013.01); **H01F 27/14** (2013.01)

Citation (search report)

- [DA] DE 19501323 A1 19960725 - MICAFIL VAKUUMTECHNIK AG [CH]
- [A] DE 19637313 A1 19970327 - HEDRICH VAKUUMANLAGEN WILHELM [DE]
- [PA] WO 0220113 A1 20020314 - HEDRICH VAKUUMANLAGEN WILHELM [DE], et al
- [A] DE 3715235 A1 19881124 - MICAFIL AG [CH]
- [A] US 5424513 A 19950613 - GMEINER PAUL [CH], et al
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 005, no. 179 (E - 082) 17 November 1981 (1981-11-17)

Cited by

CN102064018A; CN114353437A; CN102980377A; EP1528342A3; EP3029403A1; WO2011012149A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1253389 A1 20021030; EP 1253389 B1 20051116

DOCDB simple family (application)

EP 02405256 A 20020402